

# Vasca Di Decapaggio A Sfiornamento In Ptfе Ad Alta Purezza Integrata Lavello Da Laboratorio In Polietrafluoroetilene Senza Saldature

Numero articolo: PL-CP32



## introduzione

Ingegnerizzazione di vasche di sfioramento ad alta purezza in PTFE con costruzione integrata senza saldature per decapaggio chimico aggressivo. Questi lavelli durevoli senza saldature garantiscono perdite zero e una resistenza chimica superiore per le esigenti applicazioni di laboratorio industriali e semiconduttori.

## Ulteriori informazioni

Applicazione	Descrizione	Vantaggio Chiave
Incisione Wafer Semiconduttori	Bagni di acido ad alta purezza per la rimozione di film sottili e strati di ossido dai wafer di silicio.	Contaminazione zero da metalli in traccia e controllo preciso della concentrazione del bagno.
Texture Cellule Solari	Tattamento chimico su larga scala di silicio di grado solare per migliorare le proprietà di assorbimento della luce.	Resistenza chimica agli agenti di texture aggressivi e durata a lungo termine.
Decapaggio di Metalli di Precisione	Rimozione di impurità superficiali e incrostazioni da leghe speciali di grado aerospaziale e medico.	Resiste a miscele di acidi concentrati senza degradazione strutturale.
Preparazione Analisi delle Tracce	Pulizia di vetreria da laboratorio e sensori in ambiente ad alta purezza a flusso continuo.	Rumore di fondo ultra-basso e prevenzione dell'adsorbimento dell'analita.
Pulizia Farmaceutica	Sterilizzazione e pulizia di componenti ad alta purezza utilizzando agenti sanificanti aggressivi.	Superfici lisce e non porose prevengono la crescita batterica e la ritenzione chimica.
Ricerca sulle Batterie	Test di materiali per elettrodi in elettroliti corrosivi per lo sviluppo di batterie al litio e a flusso.	Isolamento chimico completo e prevenzione di perdite indotte dall'elettrolita.
Bagni di Galvanoplastica	Fornitura di un contenitore stabile e non reattivo per processi di placcatura in oro o platino speciali.	Elimina le interferenze elettrochimiche dai materiali della vasca.
Stoccaggio Chimico	Contenimento a lungo termine di reagenti ultra-puri che richiedono zero contatto con superfici metalliche o in vetro.	Conservazione del grado del reagente per lunghi periodi di stoccaggio.

Caratteristica	Dettagli Specifiche (Modello: PL-CP32)
<b>Materiale di Base</b>	100% PTFE Vergine ad Alta Purezza (Polietrafluoroetilene)
<b>Metodo di Produzione</b>	Lavorazione CNC Integrata in Unico Pezzo (Senza Saldature/Continuo)
<b>Intervallo Temperatura di Esercizio</b>	-200°C a +260°C (-328°F a +500°F)
<b>Resistenza Chimica</b>	Resistenza universale (eccetto metalli alcalini fusi e fluoro elementare)
<b>Tipo di Design</b>	Sistema di Sfiornamento Integrato Interno/Esterno
<b>Spessore Parete</b>	Standard 10mm a 30mm (Completamente Personalizzabile)
<b>Finitura Superficiale</b>	Finitura liscia ad alta precisione (Ra < 0,8 µm disponibile)

Applicazione	Descrizione	Vantaggio Chiave
Caratteristica	Dettagli Specifiche (Modello: PL-CP32)	
<b>Capacità Dimensionale</b>	Costruito su misura da piccole scale di laboratorio a grandi volumi industriali	
<b>Configurazioni Porte</b>	Porte filettate PFA/PTFE opzionali, connessioni flangiate, o sfioratori	
<b>Certificazione</b>	Conformità di sicurezza e purezza dei materiali per l'uso in camera bianca	
<b>Opzioni di Personalizzazione</b>	Dimensioni, spessore parete, design coperchio, deflettori interni, e supporti sensori	